人事異動

内閣

○外務大臣臨時代理
　国務大臣　平野　博文
外務大臣岡田克也海外出張不在中内閣法第十条の規定により臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣に指定する（五月十五日）
○外務大臣臨時代理解職
　国務大臣　平野　博文
外務大臣岡田克也帰朝につき内閣法第十条の規定による臨時に外務大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く
　長田　雅之
簡易裁判所判事兼判事補に任命する（以上五月十六日）
　能登謙太郎

法務省

　判事　本間　健裕
平成二十二年度司法試験（旧司法試験第二次試験）考査委員に任命する
任期は平成二十二年十一月三十日までとする
　佐久間邦夫
　同
平成二十二年度司法試験（旧司法試験第二次試験）考査委員を免ずる（以上五月十四日）
　杉本　令二
法務教官（京都刑務所付）法務事務官（矯正研修所広島支所教頭）に転任させる
　浅見　眞　有田　知徳
　伊藤　哲朗　上柳　敏郎
　中川　英明　長縄　友明
　星野　俊也　松山　恒昭
　三好　正弘　安田まり子
　難民審査参与員に任命する（各通）（以上五月十六日）

最高裁判所

　名古屋高等裁判所判事　片山　俊雄
名古屋地方裁判所判事に補する
　名古屋地方裁判所判事　志田　洋
名古屋高等裁判所長を命ずる
　仙台高等裁判所判事　石田　法子
名古屋高等裁判所判事に補する
　伊藤　哲朗　上柳　敏郎
部の事務を総括する者に指名する
　中川　英明　長縄　友明
　東京高等裁判所判事　星野　俊也　松山　恒昭
　三井　誠　三好　正弘　安田まり子　山田　寛
仙台高等裁判所判事に補する
　飯渕　進
名古屋高等裁判所判事に補する
部の事務を総括する者に指名する
　東京地方裁判所判事補・東京簡易裁判所判事　能登謙太郎
仙台家庭裁判所判事補に補する
仙台家庭裁判所古川支部勤務を命ずる
仙台地方裁判所古川支部勤務を命ずる
古川簡易裁判所判事に補する
兼ねて仙台地方裁判所判事補に補する
仙台地方裁判所古川支部勤務を命ずる
古川簡易裁判所判事補・岐阜地方裁判所判事補兼岐阜家庭裁判所判事補・岐阜簡易裁判所判事　田中　篤子
前橋家庭裁判所判事補に補する
前橋家庭裁判所高崎支部勤務を命ずる
兼ねて前橋地方裁判所判事補に補する
前橋地方裁判所高崎支部勤務を命ずる
高崎簡易裁判所判事に補する（以上五月十日）
　大野　昭子
判事兼簡易裁判所判事
高松地方裁判所判事に補する
兼ねて高松家庭裁判所判事に補する（五月十一日）
　伊藤　雅人
判事
東京地方裁判所判事に補する
熊本地方裁判所判事　小林　正明
広島高等裁判所判事に補する
部の事務を総括する者に指名する
　東京地方裁判所判事　難波　孝一
熊本地方裁判所判事に補する
熊本地方裁判所長を命ずる
　簡易裁判所判事　難波　孝一
熊本簡易裁判所判事に補する
熊本簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する（以上五月十一日）

○定年退官
　簡易裁判所判事田中優は五月八日限り定年退官

皇室事項

歓迎行事

　天皇皇后両陛下は、五月十七日午前九時二十分、皇居において行われたカンボジア国国王陛下の歓迎行事に御臨場になった。

御会見

　天皇皇后両陛下は、五月十七日午前九時四十分、宮中において、カンボジア国国王陛下と御会見になった。

宮中晩さん

　天皇皇后両陛下は、五月十七日午後七時三十分、カンボジア国国王陛下のため、宮中晩さんをお催しになった。

官庁報告

産業

日本工業規格

　日本工業標準調査会の調査審議を経て、平成22年5月20日に下記の日本工業規格を制定及び改正したので、工業標準化法（昭和24年法律第185号）第16条の規定に基づき公示する。
　平成22年5月20日
　経済産業大臣　直嶋　正行
記
1．制定された日本工業規格

光学素子及び光学システム用の製図手法―第14部：波面形状公差	B0090―14
光学素子及び光学システムの干渉測定―表面形状及び波面形状公差の用語	B0091
皮革面積計	B7614
空気圧―方向制御弁―切換時間及び応答時間の測定	B8419
光遮へい式液中粒子計数器―校正方法及び検証方法	B9916
品質評価システム―第2部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式の選択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順）	C5005―2
光増幅器―測定方法―第11―1部：偏波モードダイバーシティ散乱パラメータ（JME）法	C6122―11―1
光ファイバ通信サブシステム試験方法―中心波長及びスペクトル幅測定	C61280―1―3
光ファイバ通信サブシステム試験方法―受信感度及びオーバロード測定	C61280―2―1
光ファイバ通信サブシステム試験方法―光信号品質評価のための強度ヒストグラム評価を用いた平均化Q値測定	C61280―2―11
光ファイバ通信サブシステム試験方法―光アイパターン，光波形及び消光比測定	C61280―2―2
光ファイバ通信サブシステム試験方法―光アイパを用いた低ビット誤り率の決定法	C61280―2―8
光ファイバ通信サブシステム試験方法―高密度波長分割多重システムの光信号対雑音比測定	C61280―2―9
光ファイバ通信サブシステム通則	C61281―1
光ファイバ接続デバイス及び光受動部品―基本試験及び測定手順―第3―30部：多心光ファイバコネクタ用フェルールの研磨角度及び光ファイバ位置測定	C61300―3―30
表面実装技術―はんだ接合部耐久性試験方法―第1―1部：引きはがし強度試験方法	C62137―1―1
表面実装技術―はんだ接合部耐久性試験方法―第1―2部：横押しせん断強度試験方法	C62137―1―2
ボルト締めランジュバン型超音波振動子の電力計法による負荷試験方法	C6790
低圧開閉装置及び制御装置―第7部：補助装置―第1節：銅導体用端子台	C8201―7―1
鉄及び鋼―硫黄定量方法―第1部：鉄分離硫酸バリウム重量法	G1215―1
鉄及び鋼―硫黄定量方法―第2部：クロマトグラフ分離硫酸バリウム重量法	G1215―2
鉄及び鋼―硫黄定量方法―第3部：硫化水素気化分離メチレンブルー吸光光度法	G1215―3
鉄及び鋼―硫黄定量方法―第4部：高周波誘導加熱燃焼―赤外線吸収法	G1215―4
マグネシウム及びマグネシウム合金中のカドミウム定量方法	H1344
ラマン分光分析通則	K0137
温室効果ガス―第1部：組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引	Q14064―1
ソフトウェア資産管理―第1部：プロセス	Z8981
高速液体クロマトグラフィーによるフラーレンC60及びフラーレンC70の分析方法	X0164―1